

Al Direttore della Stazione Appaltante
Dott. Carlo Ferdeghini

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – Procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera b), e comma 6 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento del contratto avente a oggetto la fornitura dell'elettronica di controllo per il microscopio Omicron Nanotechnology GmbH LT-STM di proprietà CNR-SPIN da consegnare e installare presso il Laboratorio di Microscopia AFM/STM dell'Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Sede di Genova
CIG 839531511B – Lotto unico
CUP B54I20000540007
CUI 80054330586202000033
CPV 38510000-3

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto Gerbi Andrea, nato a Genova (Ge) il 25/06/1973, con riferimento alla gara di cui in oggetto ed a seguito della comunicazione inviata dal RUP contenente l'intenzione di codesta Direzione di procedere alla nomina quale componente **effettivo o supplente** della Commissione giudicatrice, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- 1) Di accettare l'incarico di cui trattasi;
- 2) Di uniformarsi ai principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" (di cui D.P.R. 16/4/2013, n. 62 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, in vigore dal 19 giugno 2013) nonché nel vigente "Codice di comportamento dei dipendenti CNR ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001;
- 3) Di prendere atto che hanno presentato offerta i sottoelencati operatori economici:

#	Concorrente	Sede legale, CF/P.IVA
1	PRA.MA. DI DA PRADA MARIO	Via C. Pisacane 1, 23035 Sondalo (SO) CF DPRMRA58T29E201N, P.IVA 00668970148
2	QUANTUM DESIGN SRL	Via F. Saponi 27, 00143 Roma (RM) CF/P.IVA 10563320158
3	SCHAEFER SOUTH-EAST EUROPE SRL	Via Luigi Einaudi 23, 45100 Rovigo (RO) CF/P.IVA 03586750279

- 4) L'assenza¹ di conflitto di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

¹ **Art. 42, comma 2 (Conflitto di interesse)** Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n° 62.

Art. 77, commi 4, 5 e 6 (Commissione giudicatrice) 4 - I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5 - Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6 - Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del C.P.C., nonché l'articolo 42 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 7, DPR 62/2013 (Obbligo di astensione) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

- 5) L'assenza¹ delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* nonché copia di un documento di identità in corso di validità nel caso di sottoscrizione con firma autografa.

Data 25/09/2020

Firmato: Andrea Gerbi

Art. 35-bis, D.LGS. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 51 C.P.C. (Astensione del giudice) Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO/EUROPEAN FORMAT

INFORMAZIONI PERSONALI/ PERSONAL INFORMATION

Nome, Cognome/Name, Surname	Andrea Gerbi
Indirizzo/Address	Corso Perrone 24, 16152
Via, numero civico, c.a.p., città, nazione/ House number, street name, postcode, city, country	Genova Italy
Telefono/Telephone	+390106598731
Fax	-
E-mail	andrea.gerbi@spin.cnr.it
Sito web/Website	http://www.spin.cnr.it/
Nazionalità/Nationality	Italian
Luogo e data di nascita/ Place and Date of birth	Genova 25th June 1973

ESPERIENZA PROFESSIONALE /WORK EXPERIENCE

Se dipendente CNR indicare:	N. MATRICOLA 14565 QUALIFICA RICERCATORE LIVELLO III
In ordine di data /Dates (from – to) [Iniziare con le più recenti ed elencare separatamente ciascun incarico ricoperto/ Add separate entries for each relevant post occupied, starting with the most recent.]	Since 2011 Researcher at the CNR-SPIN Institute, Genova (Italy). 2006-2011 Post-doctoral researcher in the group of Prof. D. Marrè at the CNR-SPIN Institute, Genova (Italy).
Nome e indirizzo del datore di lavoro / Name and address of employer	National Research Council, SuPerconducting and other INnovative materials and devices, Corso Perrone 24, 16152 Genova (Italy).
Tipo o settore di attività / Type of business or sector	Research
Funzione o posto occupato / Occupation or position held	Researcher
Principali mansioni e responsabilità / Main activities and responsibilities	Research Responsible for the equipment: Low temperature Scanning tunneling microscopy (2012-2018).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE / EDUCATION AND TRAINING

2003-2006. PhD in Physics at University of Genova, Department of Physics Via Dodecaneso 33,

In ordine di data /Dates (from – to)	16146, Genova (Italy).
[Iniziare con le più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo/ Add separate entries for each relevant course you have completed, starting with the most recent.]	2002 Physics Degree at the University of Genova, Department of Physics Via Dodecaneso 33, 16146 Genova (Italy).
Nome e tipo d'istituto di istruzione o formazione / Name and type of organisation providing education and training	University of Genova, (Italy)
Principali materie e competenze professionali apprese / Principal subjects occupational skills covered	Physics
Certificato o diploma ottenuto /Title of qualification awarded	PhD in Physics, Physics Degree
Livello nella classificazione nazionale o internazionale / Level in National classification	Not applicable

**ATTIVITA' DI RICERCA /
RESEARCH ACTIVITIES**

Attuali campi di ricerca / Research sectors	Low temperature scanning tunneling microscopy (STM) on superconductors, Condensed Matter Physics, Strongly correlated electron materials, Surfaces and interfaces characterization by Scanning Probe Microscopy (AFM).
Recenti attività scientifiche/ Recent Scientific Activities.	Scanning tunneling spectroscopy (STS) of unconventional superconductors: Atomic scale and electronic characterization of Fe-based superconductors and parent compounds. Surfaces and interfaces characterization by Scanning Probe Microscopy: Experimental studies on the friction response of materials. Atomic friction at the nano-scale in layered dichalcogenides superconductors, oxides, organic materials for electronic applications and layered materials (graphene); Ballistic electron transport (BEEM/STM) at Schottky interfaces based on functional oxides, organic semiconductors and conventional semiconductors.

Gerbi A., González C., Buzio R., Manca N., Marrè D., Bell L., Trabada D., Di Matteo S., De Andres P., Flores F. Accurate ab initio determination of ballistic electron emission spectroscopy: Application to Au/Geys. *Rev. B* 98, 205416 (2018)

Buzio R., **Gerbi A.**, Bellingeri E., Marrè D. "Temperature- and doping-dependent nanoscale Schottky barrier height at the Au/Nb:SrTiO₃ interface", *APPLIED PHYSICS LETTERS* 113, 141604 (2018)

Buzio R, **Gerbi A.**, Barra M, Chiarella F, Gnecco E, Cassinese A (2018). Subnanometer Resolution and Enhanced Friction Contrast at the Surface of Perylene Diimide PDI8-CN2 Thin Films in Ambient Conditions. *LANGMUIR* 34, 3207 DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b04149

Gerbi A., Buzio R, Kawale S, Bellingeri E, Martinelli A, Bernini C, Tresca C, Capone M, Profeta G, Ferdeghini C (2017). Atomic-scale distortions and temperature-dependent large pseudogap in thin films of the parent iron-chalcogenide superconductor Fe_{1+y}Te. *JOURNAL OF PHYSICS. CONDENSED MATTER*, vol. 29, 485002, ISSN: 0953-8984, doi: 10.1088/1361-648X/aa9103

Buzio R, **Gerbi A.**, Uttiya S, Bernini C, Castillo AED, Palazon F, Siri AS, Pellegrini V, Pellegrino L, Bonaccorso F (2017). Ultralow friction of ink-jet printed graphene flakes. *NANOSCALE*, vol. 9, p. 7612-7624, ISSN: 2040-3364, doi: 10.1039/c7nr00625j

Perasso A, Toraci C, Massone AM, Piana M, **Gerbi A.**, Buzio R, Kawale S, Bellingeri E, Ferdeghini C (2015). An automatic method for atom identification in scanning tunneling microscopy images of Fe-chalcogenide superconductors. *JOURNAL OF MICROSCOPY*, vol. 260, p. 302-311, ISSN: 0022-2720, doi: 10.1111/jmi.12297

Kisiel M, Pellegrini F, Santoro GE, Samadashvili M, Pawlak R, Benassi A, Gysin U, Buzio R, **Gerbi A.**, Meyer E, Tosatti E. Noncontact Atomic Force Microscope Dissipation Reveals a Central Peak of SrTiO₃ Structural Phase Transition. *PHYSICAL REVIEW LETTERS* 115, 046101 (2015).

Buzio R, **Gerbi A.**, Marre D, Barra M, Cassinese A. Electron injection barrier and energy-level alignment at the Au/PDI8-CN2 interface via current-voltage measurements and ballistic emission microscopy. *ORGANIC ELECTRONICS* 18, 44 (2015).

Gerbi A., Buzio R, Bellingeri E, Kawale S, Marre D, Siri AS, Palenzona A, Ferdeghini C, (2012). Superconducting FeSe_{0.5}Te_{0.5} thin films: a morphological and structural investigation with scanning tunnelling microscopy and x-ray diffraction . *SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY*, vol. 25, 012001, ISSN: 0953-2048, doi: doi:10.1088/0953-2048/25/1/012001

**ULTERIORI INFORMAZIONI /
ADDITIONAL INFORMATION**

Teaching at University :

2014, 2017, 2018 lecturer for the Phd course in Physics “Microscopic and spectroscopic techniques for the analysis of surfaces and interfaces”, University of Genova;

Other relevant scientific qualifications:

Journal citations: > 540; h-index=15 (from <https://apps.webofknowledge.com/>);

37 articles on international peer-reviewed journals;

More than 20 talks and poster presentations at international conferences ;

Member of local committee of the 22th AIV Conference, May 20-22, 2015 Genova, Italy;

Board of Professors member of the PhD schools in Physics (since 07-02-2017), University of Genova;

Projects participation:

2015-2016, PROGETTO PREMIALE INFN-CNR “EOS - Organic electronics for advanced research instrumentation” (participant of CNR research unit);

2011-2014, participant at the FP7 European Community projects. n. 283204. Acronym: SUPER-IRON. Title: “Exploring the potential of Iron-based Superconductors”. Theme NMP.2011.2.2-6.

CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PROFESSIONALI

Nome, Cognome	Renato Buzio
Indirizzo	CNR-SPIN
Via, numero civico, c.a.p., città, nazione	C.so F.M. Perrone 24, 16152 Genova
Telefono	+39 010 6598 731
Fax	
E-mail	renato.buzio@spin.cnr.it
Sito web	https://www.spin.cnr.it/people/researchers/buzio-renato

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dipendente CNR	QUALIFICA LIVELLO	RICERCATORE III
Data	16/02/2009 - oggi	
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, Roma, Italia	
Tipo o settore di attività	Materiali superconduttori, materiali innovativi e dispositivi, fisica delle superfici	
Funzione o posto occupato	Ricercatore, livello III	
Principali mansioni e responsabilità	Attività di ricerca su superconduttori innovativi, ossidi funzionali, loro superfici ed interfacce, mediante microscopie a effetto tunnel STM ed a forza atomica AFM. Responsabile di attrezzatura di microscopia AFM per l'unità operativa di Genova dell'Istituto CNR – SPIN.	
Data	20/08/2006 - 15/02/2009	
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università degli Studi di Genova, Via Balbi 5, Genova, Italia	
Tipo o settore di attività	Fisica delle Superfici	
Funzione o posto occupato	Collaboratore a progetto Co.Co.Pro.	
Principali mansioni e responsabilità	Responsabile del sottoprogetto GHM Genotype-Haplotype-Microscope del progetto MIUR FIRB NANOMED (Dipartimento di Fisica e Centro Biotecnologie Avanzate), sviluppo di dispositivi e protocolli di misura basati su microscopia a forza atomica AFM per l'indagine di biomolecole	
Data	15/08/2003 - 15/08/2006	
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, C.so Perrone 24, Genova, Italia	
Tipo o settore di attività	Fisica delle Superfici	
Funzione o posto occupato	Ricercatore a tempo determinato, livello III	
Principali mansioni e responsabilità	Studio delle proprietà tribologiche di superfici mediante microscopia a forza atomica AFM	

ATTIVITA' DI RICERCA

Attuali campi di ricerca

- Caratterizzazione delle proprietà morfologiche ed elettroniche di superconduttori innovativi, in forma di campioni massivi e film sottili, mediante microscopie STM ed AFM operanti in aria ovvero ultra-alto-vuoto e temperature criogeniche;
- Sviluppo di metodi spettroscopici, basati su microscopie STM ed AFM, per l'indagine alla nanoscala delle proprietà elettroniche di interfacce di materiali ossidi funzionali;
- Nanotribologia, attrito atomico e meccanismi fondamentali di dissipazione energetica studiati mediante microscopie STM e AFM.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Seminari a conferenze internazionali

Più di 30 lezioni e presentazioni di poster a conferenze internazionali.

Elenco degli interventi orali (ultimi 5 anni):

- 2) R. Buzio et al., "Electron injection barrier and energy-level alignment at the Au/PD18-CN2 interface", European Conference on Organised Films 14, Genoa (Italy) June 29 - July 2, 2015;
- 3) R. Buzio et al., "Resistive Switching and Nanoscale Electronic Transport in Au/Nb:SrTiO3 Schottky Junctions", "CIMTEC 2016 - 7th Forum on New Materials", Perugia (Italy), June 5 - 9, 2016.
- 4) R. Buzio et al., "Nanotribology of inkjet printed graphene flakes" at "7th European Nanomanipulation Workshop" - COST Action MP1303 - Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction, Jena (Germany) February 20 - 22, 2017.
- 5) R. Buzio et al., "Ultralow friction of ink-jet printed graphene flakes", INVITED SPEAKER NanolInnovation 2017, Rome (Italy) September 26 - 29, 2017.

Partecipazione a comitati di conferenze scientifiche internazionali (ultimi 5 anni)

Membro del comitato scientifico del "3rd International Semiconductor Science and Technology Conference ISSTC 2016" (Konia-Turkey), August 26-28, 2016.

Attività di referee internazionale

Referee for international peer-review journals published by Elsevier, Wiley, Institute of Physics, Springer, American Society of Mechanical Engineers, American Chemical Society, American Institute of Physics, American Physical Society, Nature Publishing Group.

Partecipazione a progetti scientifici nazionali ed internazionali (ultimi 5 anni)

2020-2022, Finanziamento della COMPAGNIA DI SANPAOLO per il PROGETTO "MIDA - MicroDevices for Active photonics" (partecipante dell'unità di ricerca CNR; Principal Investigator P.I. E. Bellingeri CNR-SPIN).

2019-2022, MIUR PRIN 2017 "UTFROM - Understanding and tuning friction through nanostructure manipulation" (partecipante dell'unità di ricerca CNR; responsabile scientifico dell'unità CNR-SPIN; P.I. R. Ferrando UNIGE);

2019-2020, PROGETTO BILATERALE CNR-RSE (Royal Society of Edinburgh - Scotland) "Atomic-scale imaging of the superconducting condensate in the putative triplet superconductor Sr₂RuO₄: a platform for topological quantum computations?" (partecipante dell'unità di ricerca CNR; P.I. A. Gerbi CNR-SPIN);

2015-2016, PROGETTO PREMIALE INFN-CNR "EOS - Organic electronics for advanced research instrumentation" (partecipante dell'unità di ricerca CNR; P.I. A. Aloisio INFN-UNINA);

Pubblicazioni

Coautore di 57 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali soggette a peer-review ed atti di conferenze (citazioni totali 976, H-index 17 fonte Web Of Science), 8 capitoli monografici, coinventore di 1 brevetto internazionale. Elenco pubblicazioni negli ultimi 5 anni:

- "Macroscopic Versus Microscopic Schottky Barrier Determination at (Au/Pt)/Ge(100): Interfacial Local Modulation", Gerbi, Andrea; Buzio, Renato, et al. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES Volume: 12 Issue: 25 Pages: 28894-28902 Published: JUN 24 2020
- "Benchmarking beta-Ga₂O₃ Schottky Diodes by Nanoscale Ballistic Electron Emission Microscopy" Buzio, Renato, Gerbi, Andrea; et al. ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS Volume: 6 Issue: 3 Article Number: 1901151 Published: MAR 2020

- "Accurate ab initio determination of ballistic electron emission spectroscopy: Application to Au/Ge" Gerbi, A.; Gonzalez, C.; Buzio, R.; et al. PHYSICAL REVIEW B Volume: 98 Issue: 20 Article Number: 205416 Published: NOV 21 2018
- "Temperature- and doping-dependent nanoscale Schottky barrier height at the Au/Nb:SrTiO₃ interface", Buzio, R.; Gerbi, A. et al. APPLIED PHYSICS LETTERS Volume: 113 Issue: 14 Article Number: 141604 Published: OCT 1 2018
- "Subnanometer Resolution and Enhanced Friction Contrast at the Surface of Perylene Diimide PDI8-CN2 Thin Films in Ambient Conditions" Buzio, Renato; Gerbi, Andrea; et al. LANGMUIR Volume: 34 Issue: 10 Pages: 3207-3214 Published: MAR 13 2018
- "Atomic-scale distortions and temperature-dependent large pseudogap in thin films of the parent iron-chalcogenide superconductor Fe_{1+y}Te" Gerbi, Andrea; Buzio, Renato; et al. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER Volume: 29 Issue: 48 Article Number: 485002 Published: DEC 6 2017
- "Ultralow friction of ink-jet printed graphene flakes" Buzio, R.; Gerbi, A.; et al. NANOSCALE Volume: 9 Issue: 22 Pages: 7612-7624 Published: JUN 14 2017
- "Ballistic electron and photocurrent transport in Au/organic/Si(001) diodes with PDI8-CN2 interlayers" Buzio, Renato; Gerbi, Andrea; et al. JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B Volume: 34 Issue: 4 Article Number: 041212 Published: JUL 2016
- "An automatic method for atom identification in scanning tunnelling microscopy images of Fe-chalcogenide superconductors" Perasso, A.; Toraci, C.; et al. JOURNAL OF MICROSCOPY Volume: 260 Issue: 3 Pages: 302-311 Published: DEC 2015
- "Electronic Structure of Core-Shell Metal/Oxide Aluminum Nanoparticles", Maidecchi, Giulia; Chinh Vu Duc; Buzio, Renato; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Volume: 119 Issue: 47 Pages: 26719-26725 Published: NOV 26 2015
- "Noncontact Atomic Force Microscope Dissipation Reveals a Central Peak of SrTiO₃ Structural Phase Transition" Kisiel, M.; Pellegrini, F.; Santoro, G. E.; et al. PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 115 Issue: 4 Article Number: 046101 Published: JUL 20 2015
- "Potentiality for Low Temperature-High Field Application of Iron Chalcogenide Thin Films", Kawale, S.; Bellingeri, E.; Braccini, V.; et al. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY Volume: 25 Issue: 3 Article Number: 7300305 Published: JUN 2015
- "Broadband plasmonic response of self-organized aluminium nanowire arrays", Bisio, Francesco; Gonella, Grazia; Maidecchi, Giulia; et al. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Volume: 48 Issue: 18 Special Issue: SI Article Number: 184003 Published: MAY 13 2015
- "Electron injection barrier and energy-level alignment at the Au/PDI8-CN₂ interface via current-voltage measurements and ballistic emission microscopy" Buzio, R.; Gerbi, A.; et al. ORGANIC ELECTRONICS Volume: 18 Pages: 44-52 Published: MAR 2015

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" regola il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l'interessato deve essere previamente informato del trattamento .

La norma in considerazione intende come "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

In relazione a quanto riportato, autorizzo il CNR al trattamento dei dati contenuti nel presente *curriculum vitae* e nella documentazione della quale fa parte integrante, sollevandolo da ogni responsabilità e autorizzandolo alla pubblicazione, nel sito web del CNR, della relazione inerente alle proprie ricerche svolte durante il soggiorno finanziato dal CNR nell'ambito del Programma STM . Inoltre acconsento all'aggiornamento delle informazioni intranet che mi riguardano sia relative le pubblicazioni sia alle ricerche svolte.

Sì, acconsento

Genova, 25 settembre 2020

Renato Buzio

Al Direttore della Stazione Appaltante
Dott. Carlo Ferdeghini

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – Procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera b), e comma 6 del D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento del contratto avente a oggetto la fornitura dell'elettronica di controllo per il microscopio Omicron Nanotechnology GmbH LT-STM di proprietà CNR-SPIN da consegnare e installare presso il Laboratorio di Microscopia AFM/STM dell'Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Sede di Genova

CIG 839531511B – Lotto unico

CUP B54I20000540007

CUI 80054330586202000033

CPV 38510000-3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Renato Buzio, nato a GENOVA (GE) il 23/06/1974, con riferimento alla gara di cui in oggetto ed a seguito della comunicazione inviata dal RUP contenente l'intenzione di codesta Direzione di procedere alla nomina quale componente effettivo o supplente della Commissione giudicatrice, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- 1) Di accettare l'incarico di cui trattasi;
- 2) Di uniformarsi ai principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" (di cui D.P.R. 16/4/2013, n. 62 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, in vigore dal 19 giugno 2013) nonché nel vigente "Codice di comportamento dei dipendenti CNR ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs.165/2001;
- 3) Di prendere atto che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici:

#	Concorrente	Sede legale, CF/P.IVA
1	PRA.MA. DI DA PRADA MARIO	Via C. Pisacane 1, 23035 Sondalo (SO) CF DPRMRA58T29E201N, P.IVA 00668970148
2	QUANTUM DESIGN SRL	Via F. Saponi 27, 00143 Roma (RM) CF/P.IVA 10563320158
3	SCHAEFER SOUTH-EAST EUROPE SRL	Via Luigi Einaudi 23, 45100 Rovigo (RO) CF/P.IVA 03586750279

- 4) L'assenza¹ di conflitto di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 es.m.i.;

¹ Art. 42, comma 2 (Conflitto di interesse) Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n° 62.

Art. 77, commi 4, 5 e 6 (Commissione giudicatrice) 4 - I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5 - Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6 - Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del C.P.C., nonché l'articolo 42 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 7, DPR 62/2013 (Obbligo di astensione) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

5) L'assenza¹delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.50/2016 es.m.i.;

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* nonché copia di un documento di identità in corso di validità nel caso di sottoscrizione con firma autografa.

Data 25/09/2020

Firmato: Renato Buzio

Art. 35-bis, D.LGS. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 51 C.P.C. (Astensione del giudice) Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Al Direttore della Stazione Appaltante
Dott. Carlo Ferdeghini

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – Procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera b), e comma 6 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento del contratto avente a oggetto la fornitura dell'elettronica di controllo per il microscopio Omicron Nanotechnology GmbH LT-STM di proprietà CNR-SPIN da consegnare e installare presso il Laboratorio di Microscopia AFM/STM dell'Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Sede di Genova
CIG 839531511B – Lotto unico
CUP B54I20000540007
CUI 80054330586202000033
CPV 38510000-3

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto Cristina Bernini, nato a Genova (GE) il 10/04/1963, con riferimento alla gara di cui in oggetto ed a seguito della comunicazione inviata dal RUP contenente l'intenzione di codesta Direzione di procedere alla nomina quale componente **effettivo o supplente** della Commissione giudicatrice, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- 1) Di accettare l'incarico di cui trattasi;
- 2) Di uniformarsi ai principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" (di cui D.P.R. 16/4/2013, n. 62 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, in vigore dal 19 giugno 2013) nonché nel vigente "Codice di comportamento dei dipendenti CNR ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001;
- 3) Di prendere atto che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici:

#	Concorrente	Sede legale, CF/P.IVA
1	PRA.MA. DI DA PRADA MARIO	Via C. Pisacane 1, 23035 Sondalo (SO) CF DPRMRA58T29E201N, P.IVA 00668970148
2	QUANTUM DESIGN SRL	Via F. Saponi 27, 00143 Roma (RM) CF/P.IVA 10563320158
3	SCHAEFER SOUTH-EAST EUROPE SRL	Via Luigi Einaudi 23, 45100 Rovigo (RO) CF/P.IVA 03586750279

- 4) L'assenza¹ di conflitto di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

¹ **Art. 42, comma 2 (Conflitto di interesse)** Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n° 62.

Art. 77, commi 4, 5 e 6 (Commissione giudicatrice) 4 - I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5 - Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6 - Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del C.P.C., nonché l'articolo 42 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 7, DPR 62/2013 (Obbligo di astensione) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

- 5) L'assenza¹ delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* nonché copia di un documento di identità in corso di validità nel caso di sottoscrizione con firma autografa.

Data ___25/09/2020_____

Firmato: Cristina Bernini

Art. 35-bis, D.LGS. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 51 C.P.C. (Astensione del giudice) Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

CURRICULUM VITAE

Cristina Bernini

Nata a Genova il 10 aprile 1963

Studi

Luglio 1989: Laurea in Fisica conseguita al Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova

Esperienze professionali

- | | |
|-----------|---|
| 1989-1990 | Collaborazione ad attività di ricerca presso la Sezione di Fisica Sanitaria della A.S.L. III di Genova all'interno dell'Ospedale di San Martino , nel campo della diagnostica e radio-terapia. |
| 1990-2002 | Ricercatrice (VIII livello di inquadramento, contratto metalmeccanico) presso il Centro Sviluppo Materiali S.p.A., (azienda di Ricerca e Sviluppo di livello nazionale nel campo dei materiali) |
| 2002-2004 | Tecnologo (III livello di inquadramento) presso l'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia |
| 2004-2020 | Tecnologo (III livello di inquadramento) presso il CNR |

ATTIVITA' SCIENTIFICA TECNOLOGICA

Attività svolta presso Centro Sviluppo Materiali S.p.A.

Durante il periodo lavorativo prestato presso il CSM ho svolto attività di ricerca nel campo metallurgico, relativamente alle tematiche della deformazione plastica dei materiali metallici e in particolare dello stampaggio a freddo, campo nel quale ho portato avanti attività in collaborazione con industrie di livello nazionale nel settore dell'Industria Metalmeccanica (ILVA, FIAT, IVECO, Fiat Innovazione Industriale..) e del largo consumo (Ocean, Whirlpool,...), sia in campo applicativo che in campo innovativo.

Attività svolta presso CNR

Dal 2002 sono responsabile del Laboratorio di Microscopia Elettronica e Metallografia dell'Istituto SPIN di Genova del CNR dove svolgo attività di ricerca sia per il CNR che per committenti esterni.

Partecipo a vari progetti, utilizzando la tecnologia della Microscopia Elettronica come metodo di indagine per comprendere i fenomeni legati ai materiali coinvolti nelle attività di ricerca, valutare i risultati ottenuti dalle attività sperimentali, e fornire importanti informazioni utili per il proseguimento delle attività nelle fasi successive.

In particolare, per quanto riguarda i progetti di ricerca per committenti esterni, mi sono occupata di caratterizzazioni di materiali metallici e ceramici per la MIMITALIA S.p.A., e risoluzione di problematiche di failure analysis per la PIAGGIO AERO INDUSTRIE S.P.A.

Nelle tematiche di ricerca portate avanti dal CNR, collaboro a progetti relativi a: materiali superconduttori (MgB₂, Bi-2212, "oxi-pnictidi", ed altri); nel campo della nanotecnologie, a materiali per dispositivi (transistor ad effetto di campo, pattern conduttivi); e, in collaborazione con il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale di Genova, ad attività di ricerca sulle applicazioni relative a nanoparticelle strutturate di TiO₂ (ad es. nel campo medico : potenzialità disinfettanti su batteri attraverso il processo di fotocatalisi).

Al Direttore della Stazione Appaltante
Dott. Carlo Ferdeghini

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – Procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera b), e comma 6 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento del contratto avente a oggetto la fornitura dell'elettronica di controllo per il microscopio Omicron Nanotechnology GmbH LT-STM di proprietà CNR-SPIN da consegnare e installare presso il Laboratorio di Microscopia AFM/STM dell'Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Sede di Genova
CIG 839531511B – Lotto unico
CUP B54I20000540007
CUI 80054330586202000033
CPV 38510000-3

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto Luca Pellegrino, nato a Alassio (SV) il 12/10/1975, con riferimento alla gara di cui in oggetto ed a seguito della comunicazione inviata dal RUP contenente l'intenzione di codesta Direzione di procedere alla nomina quale componente **effettivo o supplente** della Commissione giudicatrice, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- 1) Di accettare l'incarico di cui trattasi;
- 2) Di uniformarsi ai principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" (di cui D.P.R. 16/4/2013, n. 62 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, in vigore dal 19 giugno 2013) nonché nel vigente "Codice di comportamento dei dipendenti CNR ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001;
- 3) Di prendere atto che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici:

#	Concorrente	Sede legale, CF/P.IVA
1	PRA.MA. DI DA PRADA MARIO	Via C. Pisacane 1, 23035 Sondalo (SO) CF DPRMRA58T29E201N, P.IVA 00668970148
2	QUANTUM DESIGN SRL	Via F. Saponi 27, 00143 Roma (RM) CF/P.IVA 10563320158
3	SCHAEFER SOUTH-EAST EUROPE SRL	Via Luigi Einaudi 23, 45100 Rovigo (RO) CF/P.IVA 03586750279

- 4) L'assenza¹ di conflitto di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

¹ **Art. 42, comma 2 (Conflitto di interesse)** Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n° 62.

Art. 77, commi 4, 5 e 6 (Commissione giudicatrice) 4 - I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5 - Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6 - Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del C.P.C., nonché l'articolo 42 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 7, DPR 62/2013 (Obbligo di astensione) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 35-bis, D.LGS. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza

- 5) L'assenza¹ delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* nonché copia di un documento di identità in corso di validità nel caso di sottoscrizione con firma autografa.

Data 25/09/2020

Firmato: Luca Pellegrino

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 51 C.P.C. (Astensione del giudice) Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

CURRICULUM VITAE

LUCA PELLEGRINO

T: +39-010-6598731/+39-010-3536323 | M: luca.pellegrino@spin.cnr.it | Researcher ID: G-6890-2014

EDUCATION

Degree (Laurea) in Physics “summa cum laude”, Genoa Univ. (IT), 2000

Ph.D. in Physics, Genoa Univ., 2004

SHORT BIO: Luca Pellegrino is currently permanent research scientist at CNR-SPIN unit of Genoa. He received his degree in physics in 2000 and obtained his PhD in physics in 2004 from the University of Genoa in the group of Prof. Antonio Sergio Siri, discussing a thesis on “*Towards nanostructured field effect devices on perovskites: side gate transistors on SrTiO₃ by AFM anodization*”. In 2000, he joined Prof. Jean-Marc Triscone laboratory at the “Département de Physique de la Matière Condensée”, Geneva (Switzerland) where he worked on novel Surface Acoustic Waves devices (SAW) made by AFM local polarization of ferroelectric oxide thin films (PZT). In 2005, he joined Prof. Tomoji Kawai laboratory at the “Institute of Scientific and Industrial Research”, Osaka University, Osaka (Japan), where he collaborated with Prof. Hidekazu Tanaka and Prof. Takuya Matsumoto on the fabrication and characterization of planar nanodevices realized on (Fe,Mn)₃O₄ thin films. Since 2004 he collaborated with the University of Genova and the Artificial and Innovative Materials Laboratory of the National Institute for the Physics of Matter.

RESEARCH INTERESTS: Oxide electronics and oxide-based (nano)devices (field effect transistors, non-volatile memories, magnetic devices), oxide microelectromechanical systems, oxide thin film deposition by Pulsed Laser Deposition, nanofabrication techniques, inkjet printing. During the last years, he focused on the fabrication of free-standing microstructures entirely made with epitaxial transition metal oxides thin films for the realization of novel oxide-based micromechanical devices such as strain devices, multiresistive memories and programmable micromechanical resonators, microactuators, nanomechanical sensors.

APPOINTMENTS:

Research scientist (permanent)	CNR-SPIN, Genoa (IT), Jan 2010- Present
Research scientist	CNR-INFM-LAMIA, Genoa (IT), May 2007-Jan 2010
Research Fellowship	CNR-INFM-LAMIA, Oct 2006-May 2007
Visiting Scientist	ISIR-Osaka Univ. (JP), Mar 2005- Dec 2005
Post –Doctoral scholar	Genoa Univ., Sept 2004-Sept 2006
Research fellowship	INFM-Genoa, Jan 2004- Sept 2004
PhD studentship	Genoa Univ., Jan 2001-Jan 2004
Research fellowships	DPMC-Geneva Univ. (CH), May 2000- Nov 2000

SUMMARY OF SCIENTIFIC COMPETENCES:

- Thin film deposition by Pulsed Laser Deposition (PLD) and RF-magnetron sputtering.
- Structural and morphological characterization of thin films by Reflection High Energy Electron Diffraction (RHEED), X-ray Diffraction (XRD), Atomic Force Microscopy (AFM).
- AFM imaging techniques and characterization of functional materials with advanced AFM methods; AFM nanolithography by local anodic oxidation.
- Oxide device engineering and fabrication of microscale and nanoscale thin film devices.
- Low-temperature electrical and magnetic characterization of thin films, thin film devices and nanostructures.
- Mechanical characterization of microstructures.
- Thin film device modeling (structural, thermal and electrical) by Finite Element Analysis.
- Inkjet printing technique.
- Optical characterization of thin films by spectroscopic ellipsometry.

HONORS and AWARDS:

2008 ESF-THIOX award for *“for his outstanding work on nanometric patterning techniques of epitaxial oxides and on the realization of innovative nanodevices that allow the investigation of conduction mechanisms in complex oxides at the nanometer scale”*.

PARTICIPATION TO NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS: FIRB RBAP115AYN “Oxides at the nanoscale: multifunctionality and applications” and international projects (NMP-SMALL “OXIDES”) FP7, (STREP “Nanoxide”) FP6. “MELODICA” project FLAG ERA European Research Area Network, within the Joint Transnational Call (JTC) 2017 (<http://www.melodica.spin.cnr.it/index.php>)

COORDINATION OF NATIONAL/INTERNATIONAL PROJECTS:

- Winner of the 2008 INFM call for Young Researchers. Project: “Smart Micro and nanoelectromechanical Systems based on Functional Oxides (SMEMO)”
- Winner of the “2013 joint research projects within the executive programme of cooperation in the field of science and technology between Japan and Italy for the years 2013-2015”. Funding agency: Ministry of Foreign Affairs. (Partner Prof. T. Kanki- Prof. H. Tanaka, Osaka University (JP)) Title: **“Micromechanical devices based on Vanadium Dioxide Films”**
- Selected for the “Joint Research Project of Particular Relevance” within the executive programme of cooperation in the field of science and technology between Japan and Italy for the years 2017-2019. **“Solid State Actuators for Micro/Nanorobotics”** (JP Partner Prof. T. Kanki (JP coordinator) - Prof. H. Tanaka, Osaka University (JP)). Project web-site: www.vo2actuators.spin.cnr.it
- Coordinator of the bilateral project 2018-2019 between the National Research Council (CNR) and the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) in the framework of the Bilateral agreements of Scientific and Technological Cooperation. Project leaders: Luca Pellegrino (IT), Teruo Kanki (JP). Project entitled **“Domain manipulation in VO2 Freestanding Nanomechanical Structures”**. Website: <https://www.cnr.it/en/bilateralagreements/project/2958/domain-manipulation-in-vo2-freestanding-nanomechanicalstructures>
- Coordinator of the Horizon 2020 FET-Open project **“OXiNEMS-Oxide nanoelectromechanical systems for ultrasensitive and robust sensing of biomagnetic fields”** financed by the Research Executive Agency of the European Commission (2019-2023), Nr 828784. www.oxinems.eu

PATENTS:

- EU Patent N° EP 2 107 039 A2 date of filing 31.03.2009 by CNR-INFN "***Micromechanical thin film device of transition metal oxide, and manufacturing method thereof***" inventors: L. Pellegrino, M. Biasotti, A. S. Siri. (expired)
- IT Patent N° TO2014A000451 date of filing 5.06.2014 by CNR-Università di Genova "***Selective stimulation of small nerve fibres by micropatterned interdigitated surface electrodes***" inventors : M. Leandri, L. Pellegrino, A. S. Siri (under licensing)

PUBLICATIONS:

<http://orcid.org/0000-0003-2051-4837>

57 Total, > 900 Journal citations, 25/09/2020, h-index=19 from Web of Science (Clarivate Analytics)